

<p>OPTYKA, MECHANIKA PRECYZYJNA I PRZYRZĄDY POMIAROWE</p>	<p>NORMA BRANŻOWA</p>	<p><b>BN-79</b></p> <hr/> <p><b>5523-06</b></p>
	<p><b>Kondensory mikroskopowe</b> Określenia i podstawowe wymagania</p>	
	<p>Grupa katalogowa XIII 43</p>	

## 1. WSTĘP

Przedmiotem normy są określenia oraz podstawowe wymagania dotyczące kondensatorów mikroskopowych, ogólnego przeznaczenia. Norma nie dotyczy kondensatorów specjalnych, takich jak: kondensory do kontrastu fazowego, kondensory do ciemnego pola oraz kondensory długoogniskowe.

## 2. OKREŚLENIA

**2.1. Kondensator Abbego** — dwusoczewkowy kondensator o zminimalizowanej aberracji sferycznej.

**2.2. Kondensator aplanatyczny** — kondensator o skorygowanych: aberracji sferycznej i odstępstwie od warunku sinusów.

**2.3. Kondensator achromatyczny** — kondensator o skorygowanej aberracji chromatycznej.

**2.4. Kondensator aplanatyczno-achromatyczny** — kondensator o skorygowanych: aberracji sferycznej, odstępstwie od warunku sinusów i aberracji chromatycznej.

**2.5. Kondensator immersyjny** — kondensator przystosowany do pracy w układzie, w którym między konden-

sorem a szkiełkiem podstawowym znajduje się ciecz immersyjna.

**2.6. Kondensator suchy** — kondensator przystosowany do pracy w układzie, w którym między kondensorem a szkiełkiem podstawowym nie stosuje się cieczy immersyjnej.

**2.7. Odległość czołowa** — odległość między ostatnią powierzchnią kondensatora (leżącą najbliżej preparatu) a płaszczyzną przewężenia wiązki światła wychodzącego z kondensatora (np. płaszczyzną obrazu przysłony połowej).

**2.8. Pozostałe określenia** — wg PN-78/N-02303 i PN-79/N-53000,

## 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE

**3.1. Średnica osadczą kondensatora** powinna wynosić 39,5 f9.

**3.2. Odległość czołowa** mierzona w powietrzu nie powinna być mniejsza niż 1,1 mm, ponadto w kondensatorach immersyjnych odległość ta nie powinna być większa niż 1,7 mm.

**3.3. Aparatura numeryczna kondensatora immersyjnego** nie powinna być mniejsza niż 1,1.

K O N I E C

## INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa.

**2. Normy związane**  
PN-78/N-02303 Optyka geometryczna. Nazwy, określenia i oznaczenia pojęć podstawowych  
PN-79/N-53000 Mikroskopy. Podstawowe nazwy i określenia

**3. Normy zagraniczne**  
NRD TGL 6156 Bl.8 Mikroskope. Beleuchtungseinrichtungen für Durchlicht. Technische Lieferbedingungen

**4. Symbol wg SWW** — 0952-8.

**5. Autor projektu normy** — mgr inż. Tomasz Kozłowski, Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Optyki  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego OMEL  
dnia 22 grudnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1980 poz. 17)